

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年8月28日(2014.8.28)

【公開番号】特開2012-64935(P2012-64935A)

【公開日】平成24年3月29日(2012.3.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-013

【出願番号】特願2011-178849(P2011-178849)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/302 1 0 3

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月14日(2014.7.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光源装置と、
光源装置で発光する光を伝搬する光ファイバと、
撮像部と、
電極針と、
前記電極針に電力を供給する電源装置と、
前記光ファイバ、前記撮像部及び前記電極針を覆う被覆材と、
を有することを特徴とする微粒子捕集装置。

【請求項 2】

処理室と、
第 1 の電源装置と、
ガス供給源と、
排気装置と、を有し、
前記処理室は、電極と、微粒子捕集装置の一部と、を有し、
前記第 1 の電源装置は、前記電極と接続されており、
前記ガス供給源は、前記処理室と接続されており、
前記排気装置は、前記処理室と接続されており、
前記微粒子捕集装置は、
光源装置と、
光源装置で発光する光を伝搬する光ファイバと、
撮像部と、
電極針と、
前記電極針に電力を供給する第 2 の電源装置と、
前記光ファイバ、前記撮像部及び前記電極針を覆う被覆材と、を有し、
前記処理室に設けられた微粒子捕集装置の一部は、前記光ファイバ、前記撮像部、前記

電極針、及び被覆材であることを特徴とする真空処理装置。